【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成19年5月10日(2007.5.10)

【公表番号】特表2006-523382(P2006-523382A)
【公表日】平成18年10月12日(2006.10.12)
【年通号数】公開・登録公報2006-040
【出願番号】特願2006-508912(P2006-508912)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/3065　(2006.01)
Ｈ０５Ｈ　 1/46　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/302　１０１Ｇ
Ｈ０５Ｈ　 1/46　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成19年3月13日(2007.3.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
フォーカスリングと、
前記フォーカスリングと組み合わされた二次的なフォーカスリングと、を具備し、
前記フォーカスリングは、処理システムの処理にさらされる基板を支持するように構成された基板ホルダに組み合わされるように構成され、前記二次的なフォーカスリングは、前記基板の裏側表面上の、前記処理からの材料の堆積を減らすように構成されている基板ホルダ。